

©1995 г.

## ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ РАЗНЕСЕННЫХ СВЕРХРЕШЕТОК $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$

*В.И.Кадушкин, Е.Л.Шангина*

Научно-исследовательский технологический институт,  
390011, Рязань, Россия  
(Получена 28 мая 1992 г. Принята 14 сентября 1994 г.)

Выращены две серии разнесенных сверхрешеток (PCP)  $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$ : 1 — с однородно легированными квантовыми ямами и 2 — с  $\delta$ -Si-легированными барьерами. Ширина квантовых ям от 33 до 66 Å, барьерах слоев — 250 Å. Уровень легирования  $N_d \simeq 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .  $\delta$ -слои Si располагались на расстоянии от 30 до 74 Å от гетерограницы.

Энергетическое положение пиков спектров фотолюминесценции обнаруживалось температурный сдвиг ( $T = 4.2 \div 300$  K), соответствующий изменению ширины запрещенной зоны GaAs. Нами рассчитана зонная диаграмма гетероструктуры с  $\delta$ -Si-легированными барьераами слоями и установлено, что волновая функция основного состояния локализована в слое GaAs. Показано, что спектры фотолюминесценции обусловлены электронными переходами с основного уровня электронов в квантовой яме на уровень тяжелых дырок.

Сопоставительный анализ спектров фотолюминесценции и кинетических параметров обеих серий разнесенных сверхрешеток показал лучшее структурное совершенство разнесенных сверхрешеток с  $\delta$ -легированием. Полуширина линии спектра фотолюминесценции структур 1-й серии  $13 \div 21$  мэВ, а 2-й —  $5 \div 9$  мэВ. Подвижности электронов при  $T = 4.2$  K в 1-й серии  $200 \div 800 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ , а во 2-й — до  $5500 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ .

По спектрам фотолюминесценции и величинам подвижностей для структур с различной шириной квантовых ям найдены поперечные и латеральные размеры островков (шероховатостей)  $\Delta = 2.83$  Å и  $\Lambda > 100$  Å соответственно.

### Введение

Легированные сверхрешетки (СР) — объект, исключительно интересный для фундаментальных исследований. Они особенно привлекательны для моделирования эффектов релаксации электронов на: 1 — хаотически распределенных фоновых примесях, 2 — искажениях потенциального рельефа из-за некоррелированного и коррелированного

распределения легирующей примеси в высокой концентрации, 3 — шероховатостях границ раздела структуры, 4 — экранированном кулоновском потенциале удаленных ионов легирующей примеси, локализованных в  $\delta$ -плоскости. Те или иные механизмы релаксации можно подавлять или стимулировать как композицией структуры, так и выбором метода легирования: однородное или  $\delta$ -образное, квантовых ям или барьерных слоев.

В прикладном аспекте легированные сверхрешетки нашли применение как фотоприемники, чувствительные к ИК излучению в области 8–14 мкм с характеристиками на уровне лучших достижений современной полупроводниковой оптоэлектроники [1–3]. Технология молекулярно-пучковой эпитаксии открывает определенные перспективы создания фоточувствительных элементов с широкими функциональными возможностями [4]. Фоточувствительность полупроводниковой системы в [1–4] достигается за счет создания резервуара электронов в квантовой яме однородным легированием последней непосредственно. В альтернативной системе  $i\text{-GaAs}/\text{AlGaAs}(\delta\text{-Si})$ , предложенной в [5], легируется тройное соединение ( $\delta$ -слой кремния), и электроны локализуются в квантовых ямах. Такая структура, по оценкам, обладает меньшим темновым током, большей квантовой эффективностью (в пересчете на 1 яму) и лучшей селективной чувствительностью. Неочевидны энергетическая структура гетеросистемы  $\text{AlGaAs}(\delta\text{-Si})/i\text{-GaAs}/\text{AlGaAs}(\delta\text{-Si})$ , характер распределения электронов в  $\delta$ -слоях Si и потенциальных ямах  $i\text{-GaAs}$  в зависимости от их взаимного расположения и уровня легирования.

Квантовая эффективность реальной полупроводниковой системы ( помимо внешних факторов, например способа «заведения» возбуждающего излучения) во многом определяется внутренним совершенством структуры. Последнее жестко связано как с уровнем технологии, так и с дефектами (их природой и свойствами), присущими конкретной полупроводниковой структуре. В частности, как проявляются в фотоэлектрических характеристиках искажения потенциального рельефа, вызванные латеральными и осевыми флюктуациями гетерограницы? Почему на структурах, выращенных в сходных технологических условиях, в спектрах наблюдают сложную экситонную структуру или отдельную линию? Какова соотносительная роль факторов, определяющих форму линии спектра, и как они проявляются в кинетических эффектах? Несмотря на большое число публикаций по оптическим свойствам двумерных гетеросистем, в том числе и сверхрешеток, степень и отчетливость понимания физических процессов (кинетических и рекомбинационных) [6,7] достаточно далеки от завершенности, достигнутой для объемных аналогов [8,9]. Естественной представляется задача исследовать и сопоставить фотоэлектрические и кинетические свойства электронных систем  $\text{AlGaAs}/n\text{-GaAs}/\text{AlGaAs}$  и  $\text{AlGaAs}(\delta\text{-Si})/i\text{-GaAs}/\text{AlGaAs}(\delta\text{-Si})$ -легированных сверхрешеток разнесенного типа. Термин «сверхрешетка разнесенного типа» отражает то обстоятельство, что квантовые ямы (КЯ) GaAs разнесены барьером AlGaAs на расстояние, не допускающее перекрытия волновых функций электронов в соседних КЯ.

# 1. Техника и методика эксперимента

Методом эпитаксии из молекулярных пучков на установке серии «Цна» выращены сверхрешетки разнесенного типа в виде чередующихся легированных кремнием до уровня  $(2 \div 3) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  слоев GaAs различной толщины  $L_z$  и барьераных слоев  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  ( $x \approx 0.30$ ) толщиной  $L'_z = 254 \text{ \AA}$  (серии № 100–104, 174–187). Во второй серии PCP (№ 225–228) легировались слои  $i\text{-Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$ , причем  $\delta$ -слои кремния располагались на различном расстоянии от гетерограницы  $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$  ( $L_{z\delta} = 30 \div 74 \text{ \AA}$ ) при ширине квантовой ямы  $L_z = 51 \text{ \AA}$ . Для выяснения эффектов, привносимых легированием, несколько структур выращено без легирования (№ 188, 224 и 299). Сверхрешетка отделена от полуизолирующей подложки барьераным слоем  $i\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  ( $\approx 1 \text{ мкм}$ ). Структура заканчивалась контактным слоем  $n\text{-GaAs}$  толщиной 200  $\text{\AA}$ . Несколько структур имело внутренний (непосредственно между буфером и сверхрешеткой) контактный слой. Параметры образцов приведены в табл. 1, 2.

Спектры фотолюминесценции измерялись при трех фиксированных температурах 300, 77 и 4.2 К. Образцы размещались на оправке измерительного штока с двумя световодами. По одному из них излучение от лазера ЛГ-106М заводилось на образец, а другой, приемный, торец которого был расположен в фокальной плоскости миниатюрной линзы, служил выводом излучения. Спектры фотолюминесценции анализировались на спектрометре МДР-23. Максимальный уровень возбуждения на длине волны  $\lambda = 0.5145 \text{ мкм}$  составлял 35 Вт/см<sup>2</sup>.

Таблица 1.

| №<br>п.п. | №<br>PCP | $L_z, \text{\AA}$ | $E_M, \text{эВ}$ |       |       | 4.2 | $\Delta E_{1/2}, \text{мэВ}$ |      |      |
|-----------|----------|-------------------|------------------|-------|-------|-----|------------------------------|------|------|
|           |          |                   | 300              | 77    | 4.2   |     | 300                          | 77   | 4.2  |
| 1         | 174      | 33                | 1.570            | 1.670 | 1.678 | 160 | 46.0                         | 33.0 | 21.0 |
| 2         | 175      | 44                | 1.530            | 1.648 | 1.651 | 133 | 23.0                         | 20.0 | 13.0 |
| 3         | 226      | 51                |                  |       | 1.624 | 106 |                              |      | 6    |
| 4         | 224      | 51                |                  |       | 1.630 | 112 |                              |      | 6    |
| 5         | 104      | 55                | 1.477            | 1.596 | 1.600 | 82  | 53                           | 30   | 20.0 |
| 6         | 102      | 55                | 1.463            | 1.590 | 1.599 | 81  | 50                           | 26   | 19.3 |
| 7         | 100      | 55                | 1.482            | 1.603 | 1.696 | 88  | 58                           | 23   | 21.0 |
| 8         | 188      | 55                | 1.490            | 1.595 | 1.693 | 85  | 20                           | 6    | 5    |
| 9         | 187      | 66                | 1.490            | 1.580 | 1.587 | 69  | 30                           | 20   | 15   |
| 10        | 299      | 108               |                  |       | 1.540 | 22  |                              |      | 4    |

Таблица 2.

| №<br>PCP | $L_z, \text{\AA}$ | $L_{z\delta}, \text{\AA}$ | $n_1, 10^{12} \text{ см}^{-2}$ | $\mu_A^{\text{exp}}, \text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | $\mu_A^{\text{calc}}, \text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | $\Lambda, \text{\AA}$ | $E_{1h}^{\text{exp}}, \text{эВ}$ | $E_{1h}^{\text{calc}}, \text{эВ}$ |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 227      | 51                | 59                        | 0.99                           | 5500  | 5371   | 110                   | 1.625                            | 1.622                             |
| 228      | 51                | 73.5                      | 0.65                           | 5000  | 4861   | 150                   | 1.629                            | 1.623                             |

## 2. Анализ экспериментальных результатов

1. На рис. 1 представлены спектры фотолюминесценции, иллюстрирующие основные особенности. Прежде всего следует отметить эффект смещения в спектрах ФЛ легированных (2, 3) и нелегированных РСР (7, 8) и существенное увеличение энергии  $E_M$  максимума спектров ФЛ с уменьшением температуры от 300 до 77 К, который практически не смещается при дальнейшем понижении температуры (кривые 4–6).

Используя выражение для температурной зависимости ширины запрещенной зоны GaAs из [10]

$$E_g(T) = 1.519 - 5.405 \cdot 10^{-4} T^2 / (204 + T), \quad (1)$$

можно оценить сдвиг  $\Delta E_g(300 - 4.2 \text{ K}) = 96 \text{ мэВ}$ , что весьма близко к экспериментальной величине 97 мэВ (для структуры № 187).

Измерения полуширины спектров ФЛ  $\Delta E_{1/2}$  показывают сужение линий с уменьшением температуры. Легирование несколько смещает энергетическое положение линий и приводит к уширению спектра ФЛ (структурь серии № 100–104 и 174–187). Результаты анализа спектров ФЛ исследованных РСР представлены в табл. 1.

Эффект смещения максимума спектра ФЛ однородно легированных СР в коротковолновую область по сравнению с переходами в объемном GaAs естествен:

$$\lambda_M = 1.24/E_M, \quad E_M = E_1 + E_g(0), \quad (2)$$

где  $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2m_e^* L_z^2 + \pi^2 \hbar^2 / 2m_h^* L_z^2$  сумма энергий размерного квантования электронов и тяжелых дырок, отсчитанных от дна зоны проводимости и потолка валентной зоны соответственно:  $E_g(0)$  — ширина запрещенной зоны GaAs при 0 К;  $\lambda$  выражена в мкм, а  $E$  — в эВ. На рис. 2 построена функциональная зависимость  $E_1^{\exp}(L_z)$ , установленная по спектрам ФЛ (рис. 1) и величине  $E_g(0) = 1.518 \text{ эВ}$  для  $T = 4.2 \text{ К}$ . На этом рисунке приведены данные из работ [11, 12].

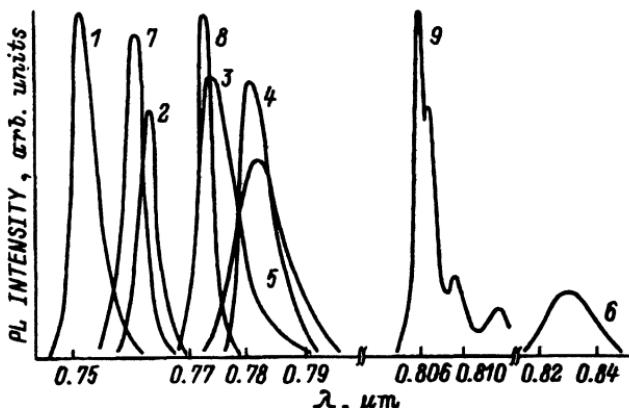


Рис. 1. Спектры фотолюминесценции разнесенных сверхрешеток с различной шириной квантовой ямы.

РСР: 1 — № 175, 2 — № 227, 3 — № 104, 4 — № 187, 7 — № 224, 8 — № 188, 9 — № 299 при  $T = 4.2 \text{ К}$ , 5 — № 187 при  $T = 77 \text{ К}$  и 6 — № 187 при  $T = 293 \text{ К}$ . 7–9 — нелегированные РСР.

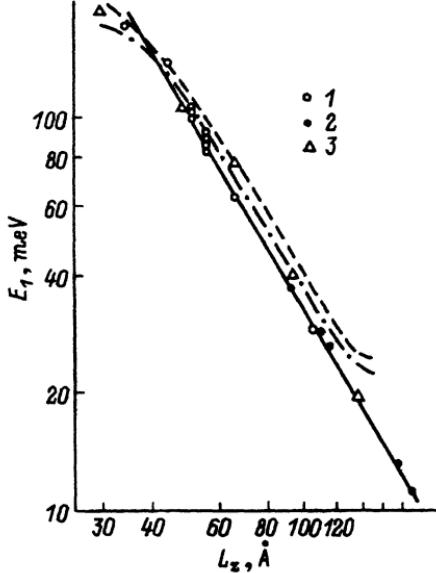


Рис. 2. Энергия квантования носителей  $E_1$  в КЯ разнесенных сверхрешеток в зависимости от ширины квантовой ямы  $L_z$  при  $T = 4.2$  К

Точки: 1 — наши данные, 2 — из работы [11] и 3 — из [12]. Штрихпунктирная линия — решение уравнения Шредингера для электронов в КЯ с барьером конечной высоты 300 мэВ для  $x = 0.30$  и  $\alpha = 0.85$ , штриховая линия — расчет с учетом квантования в валентной зоне.

Экспериментальная зависимость  $E_1^{\exp}(L_z)$  хорошо аппроксимируется законом  $E_1 \sim L_z^{-1.6}$  (сплошная линия). Отклонение экспериментальной зависимости  $E_1^{\exp}(L_z)$  от квадратичного закона (2) следует объяснить конечной высотой потенциального барьера КЯ. На рис. 2 штрихпунктирной линией показаны результаты решения уравнения Шредингера для квантовой ямы конечной глубины [13]  $E_1^{\text{calc}}(L_z)$  без учета квантования в валентной зоне и штриховой линией с учетом квантования в валентной зоне. В расчетах использовались известные соотношения для разрыва зоны проводимости в системе GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As:

$$\Delta E_c = \alpha [E_g(x) - E_g(0)], \quad (3)$$

где  $E_g(x) = 1.518 + 1.247x$  — ширина запрещенной зоны тройного соединения при  $T = 4.2$  К. (Отметим неоднозначность численного коэффициента разрыва зон  $\alpha = \Delta E_c / \Delta E_g$ : 0.85 — [14], 0.66 — [15], 0.65 — [16], 0.60 — [17, 18]). Близость результатов расчетов  $E_1$  по (2) и [13] с учетом конечной глубины потенциальной ямы, как и следовало ожидать, свидетельствует об определяющей роли в энергетической структуре ширины квантовой ямы  $L_z$ . Расчетные значения энергии переходов с учетом квантования тяжелых дырок  $E_1^{\text{calc}}$  и экспериментальные значения  $E_1^{\exp}$  хорошо совпадают (рис. 2); это позволяет связать одиночные линии в спектрах ФЛ легированных РСР с рекомбинацией пар электрон–тяжелая дырка  $1e \rightarrow 1hh$ .

Уширение спектров естественно связать с флюктуациями потенциального рельефа КЯ вследствие островкового характера роста, присущего технологии эпитаксии из молекулярных пучков. Влияние пространственных неоднородностей  $\Delta L_z = \Delta$  (по ширине КЯ) и  $\Delta L_{xy} = \Lambda$  (латеральный размер островков) на спектр ФЛ сверхрешеток рассмотрено в [6, 11, 19–21]. Нетрудно показать, что из  $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2m_e^* L_z^2$  следует  $\Delta E_{1/2}/E_1 = \Delta L_z/L_z$ . Оценка  $\Delta L_z$  для нелегированной РСР № 188

при 4.2 К дает результат 3.0 Å, т.е. величину, близкую к одному мономольному слою (2.83 Å), что хорошо согласуется с известными из литературы данными [11]. Величина  $\Delta L_z$  для аналогичной, но легированной РСР с  $\Delta E_{1/2} \approx 20$  мэВ определяет высоту ступеньки островка 12 Å, что маловероятно по соображениям технологии роста. Возможной причиной такого уширения является легирование квантовых ям.

Эксперименты и расчеты [22–24] показывают, что в КЯ с  $L_z \leq 60$  Å основным фактором, ограничивающим подвижность двумерных электронов, являются шероховатости границ раздела гетеросистемы. В работе [24] установлена связь между подвижностью  $\mu$ , характерными размерами островков  $\Delta$  и  $\Lambda$  и флуктуацией энергии  $\delta E_\mu$  основного состояния в квантовой яме шириной  $L_z$ . Явления переноса в исследованных здесь структурах изучены в [25–27]; спектры электро- и фотоотражения — в [28]. Для структур № 174, 175 и 187 по величинам подвижностей 260, 480 и 860 см<sup>2</sup>/В·с, воспользовавшись данными расчетов работы [24], мы нашли  $\delta E_\mu = 30, 16$  и  $7 \cdot 10^{-3}$  эВ [25]. Эти данные очень хорошо согласуются с результатами из спектров ФЛ — 21, 13 и  $15 \cdot 10^{-3}$  эВ соответственно. Измерения низкотемпературного магнитотранспорта позволили оценить концентрацию электронов в квантовых ямах структур № 225–228:  $n_1 = (6.5 \div 9.9) \cdot 10^{11}$  см<sup>-2</sup>, что соответствует объемной концентрации  $n \approx 10^{18}$  см<sup>-3</sup> (уровень легирования  $\approx 2.0 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>) [26].

2. На основе данных [25, 26] были выполнены расчеты зонной диаграммы структур с  $\delta$ -слоями Si. При расчете пары соседних КЯ, образованных прослойками GaAs и  $\delta$ -Si в AlGaAs, рассматривалась как единая квантово-механическая система, что обусловлено малостью  $L_{z\delta}$  по сравнению с боровским радиусом электрона на примеси в AlGaAs.

Расчет был основан на самосогласованном решении уравнений Шредингера и Пуассона. Положения энергетических уровней рассчитывались с помощью методики, использующей операции с матрицами [29]. Концентрация доноров Si в плоскости  $\delta$ -слоев, необходимая для расчета, приравнивалась двумерной концентрации носителей в едини-

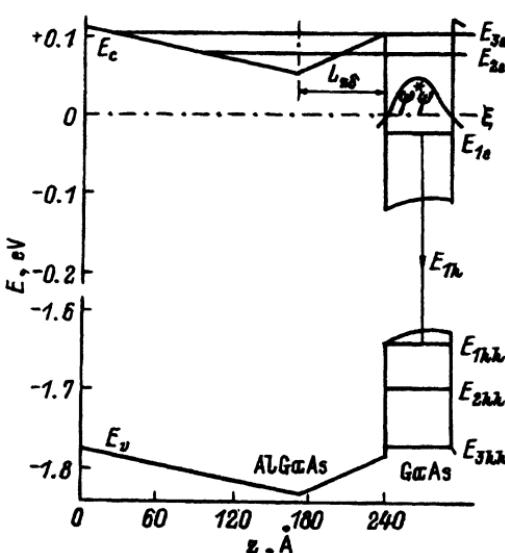


Рис. 3. Типичная зонная диаграмма периодически повторяющегося участка РСР с  $\delta$ -легированием при  $T = 4.2$  К (структуре № 228). Штрихпунктирная линия — уровень химического потенциала. Показан профиль нормированной волновой функции основного состояния электронов. Стрелкой обозначен переход  $1e \rightarrow 1hh$  с энергией  $E_{1h}$ , наблюдающийся в спектрах ФЛ  $\delta$ -легированных РСР.

ственной заполненной подзоне  $n_1$ , полученной из измерений шубниковских осцилляций. Расчет проводился для  $T = 4.5\text{ K}$ , параметра разрыва зон  $\alpha = \Delta E_c / \Delta E_g = 0.6$  в предположении квадратичного закона дисперсии. Типичная зонная диаграмма одиночного периода РСР, полученная таким образом, представлена на рис. 3.

Результаты расчета подтверждают предположение о том, что при концентрации легирующей примеси  $N_d < 1 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$  в двумерной системе связанных квантовых ям, образованных прослойками  $i\text{-GaAs}$  и  $\delta\text{-Si}$  в  $\text{AlGaAs}$ , заполнена лишь первая подзона. Волновая функция, соответствующая этой подзоне, локализована в слое GaAs.

В спектрах ФЛ при  $T = 4.2\text{ K}$  наблюдаются переходы  $1e \rightarrow 1hh$ , обусловленные рекомбинацией свободных носителей — электрона и тяжелой дырки; экспериментально полученная энергия перехода  $E_{1h}^{\exp}$  близка к расчетному значению  $E_{1h}^{\text{calc}}$ , полученному при анализе зонной диаграммы соответствующей структуры (см. рис. 3 и табл. 2). При этом полуширина спектра ФЛ составляет  $5 \div 9 \text{ мэВ}$ , что соответствует величине флюктуации  $\Delta E^{ph} \simeq 6.5 \text{ мэВ}$  энергии основного состояния, вызванной монослойным изменением ширины КЯ с  $L_z = 51 \text{ \AA}$  из-за островкового характера гетерограниц.

Заметим, что в одиночных  $\delta$ -легированных квантовых ямах ( $L_z = 50 \div 100 \text{ \AA}$ ), выращенных по аналогичной технологии, полуширина линии спектра ФЛ составляла  $2 \div 3 \text{ мэВ}$  (для  $T = 4.2 \div 77 \text{ K}$ ). Так что уширение линии ФЛ в сверхрешетках № 225–228 имеет, видимо, накопительный по квантовым ямам характер.

3. Как известно [24], подвижность двумерных носителей в КЯ структур  $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$  шириной  $L_z \leq 60 \text{ \AA}$  определяется рассеянием на шероховатостях поверхностей раздела. Следует предположить, что подвижность носителей в структурах № 225–228 с толщиной слоя GaAs  $L_z = 51 \text{ \AA}$  также контролируется этим механизмом рассеяния.

Из анализа осцилляций Шубникова–де–Гааза в предположении, что проводимость  $i$ -й подзоны начинает осциллировать, когда магнитное поле достигает значения  $1/\mu_i$ , были определены экспериментальные значения подвижности носителей в первой подзоне  $\mu_{\Delta}^{\exp}$ . Затем по методике, описанной в [24], был проведен расчет значений подвижности  $\mu_{\Lambda}^{\text{calc}}$ , ограниченной рассеянием на шероховатостях поверхностей раздела КЯ с  $L_z = 51 \text{ \AA}$ , при соответствующей табл. 2 концентрации носителей в КЯ  $n_1$  для двух структур — № 227 и 228.

Экспериментальные и расчетные значения подвижности хорошо совпадают, причем наилучшее согласие достигается при использовании в расчете  $\mu_{\Lambda}^{\text{calc}}$  значений латерального размера островка  $\Lambda = 110 \div 150 \text{ \AA}$  и его высоты  $\Delta = 2.83 \text{ \AA}$  (табл. 2).

4. Целесообразно сравнить параметры исследованных нами структур с данными измерений сверхрешеток [30] с  $\delta$ -легированием квантовых ям. Такое сопоставление данных для температур 77 и 300 K приведено на рис. 4. Видно, что структуры с  $\delta$ -легированием квантовых ям выигрывают в концентрации электронов по отношению к однородно легированным аналогам. Это является подтверждением эффективности метода  $\delta$ -легирования. Тот факт, что в наших однородно легированных СР подвижность выше, говорит о лучшем их структурном совершенстве (качество границ раздела). Однако и в этом случае  $\delta$ -легирование

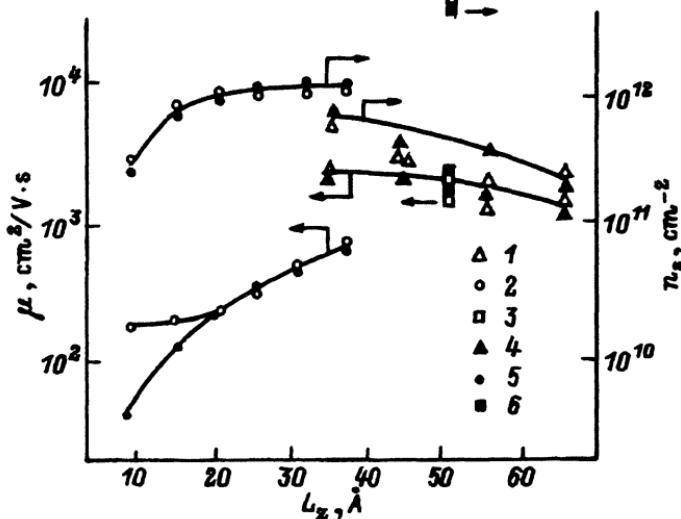


Рис. 4. Сопоставление кинетических параметров: концентрации и подвижности в сверхрешетках с разной шириной квантовых ям с однородным (1, 4) и  $\delta$ -легированием (2, 5) квантовых ям и  $\delta$ -легированием барьера (3, 6). Зависимости (2, 5) из работы [30].  $T, K: 1-3 - 77, 4-6 - 300$ .

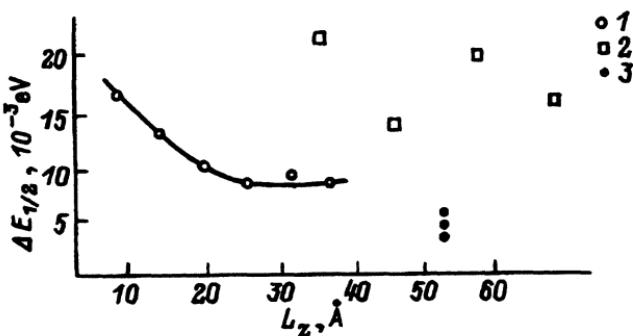


Рис. 5. Сравнение зависимости полуширины линий излучения от ширины квантовой ямы  $L_z$  структур с разным способом легирования: 1 —  $\delta$ -легирование квантовых ям (данные [30],  $T = 5$  К; 2 — однородное легирование квантовых ям, 3 —  $\delta$ -легирование барьера,  $T = 4.2$  К (наши данные)).

барьерных слоев (данные для  $L_z = 51 \text{ \AA}$ ) обеспечивает существенно большую концентрацию электронов в квантовых ямах по отношению к структурам с  $\delta$ -легированием квантовых ям.

На рис. 5 выполнено сравнение зависимостей полуширины  $\Delta E_{1/2}$  спектральных линий фотолюминесценции от ширины квантовой ямы наших структур и данных из работы [30]. И по этому параметру структуры серии № 225–228 обнаруживают лучшее качество. Полуширина  $\Delta E_{1/2}$  структур с  $\delta$ -легированием барьера существенно меньше, чем у структур из работы [30] и у структур с однородно легированными квантовыми ямами.

Меньшей полуширине спектральной линии соответствует и меньшая величина флуктуации энергии основного состояния (см. разд. 2,

и. 1), что предполагает лучшую селективную чувствительность сверхрешетки как фотоприемника.

Следует также отметить, что  $\delta$ -легирование барьераных слоев не ухудшает качества границ раздела структуры. В структурах с легированием квантовых ям гетерограница неизбежно «испорчена» подлегированием барьераных слоев диффузией кремния, что может создавать дополнительный канал рекомбинации.

5. Лучшее качество сверхрешеток с  $\delta$ -легированием барьераных слоев по  $\Delta E_{1/2}$ - и  $n_s$ -параметрам достигнуто за счет уровня технологии. Совершенные границы раздела в технологии МЛЭ получают с использованием пульсирующих молекулярных пучков [20] или прерыванием роста [6]. Высокое качество структур (как сверхрешеток, так и одиночных КЯ) в нашем случае обусловлено использованием эффузионной ячейки специальной формы, обеспечивающей рост в потоке  $As_2 + As_4$ . При одной и той же скорости роста время образования одного монослоя As из потока  $As_2$  меньше, чем из потока  $As_4$ . Это приводит к повышенной миграции атомов Ga и образованию островков больших размеров, что в конечном счете улучшает качество гетерограницы.

### Заключение

В работе исследованы спектры фотолюминесценции двух серий сверхрешеток: 1 — с однородно легированными квантовыми ямами (аналог [1]) и 2 — с  $\delta$ -легированием барьераных слоев с различным соотношением толщин слоев GaAs и AlGaAs и положением  $\delta$ -слоя Si относительно гетерограницы.

Выполнен квантово-механический расчет зонной диаграммы  $GaAs/Al_xGa_{1-x}As(\delta-Si)$  для  $x = 0.30$  и показано, что электроны локализованы на основном уровне размерного квантования в GaAs. Проведен сопоставительный анализ спектров фотолюминесценции и кинетических параметров ( $n_s$  и  $\mu$ )  $GaAs'/AlGaAs(\delta-Si)$ -сверхрешетки с однороднолегированной  $GaAs(Si)/AlGaAs$  (аналог [1]) и  $GaAs(\delta-Si)/AlGaAs$  [30]. Показано, что  $GaAs/AlGaAs(\delta-Si)$ -сверхрешетка, как фотоприемный элемент, обладает лучшими свойствами: для одинакового уровня легирования концентрация электронов в яме выше и линия излучения уже, что предполагает больший квантовый выход при той же активной области и лучшую спектральную избирательность. Эти особенности определены как уровнем технологии синтеза, так и выбором метода легирования.

Авторы выражают благодарность В.М. Скороходову за консультации при проведении расчетной части работы и О.Л. Кураксину за обсуждение вопросов технологии.

Выполнение работы частично финансировалось Программой РАН «Физика твердотельных наноструктур» (проекты № 2-014 и 2-016/2).

### Список литературы

- [1] B.F. Levine, C.G. Bethea, G. Hasnain, I. Walker, R.I. Malik. Appl. Phys. Lett., **53**, 296 (1988).
- [2] G. Hasnain, B.F. Levine, C.G. Bethea, R.A. Logan, I. Walker, R.I. Malik. Appl. Phys. Lett., **54**, 2515 (1989).
- [3] B.F. Levine, G. Hasnain, C.G. Bethea, M. Chang. Appl. Phys. Lett., **54**, 270 (1989).

- [4] M. Migita, T. Uda, O. Kauchisa, M. Shiiki. Заявка ЕР 0316909 A2, H01L 31/02 G/1C 13/04. *Semiconductor Optical apparatuses*.
- [5] В.И. Кадушкин. Заявка № 5029920(25) 010023 с приоритетом от 28.02.92.
- [6] M.A. Herman, D. Bimberg, J.J. Christen. Appl. Phys., **70**, R1 (1991).
- [7] А.Я. Шик. ФТП, **26**, 1161 (1992).
- [8] С.М. Рывкин. *Фотоэлектрические явления в полупроводниках* (М., 1963).
- [9] А.В. Войцеховский, В.И. Давыдов. *Фотоэлектрические МДП структуры из узкозонных полупроводников* (Томск, 1990).
- [10] Х. Кейси, М. Паниш. *Лазеры на гетероструктурах* (М., 1981) т. 1.
- [11] D.C. Reynolds, K.K. Bajaj, S.W. Linon, P.W. Yu, J. Singh, W.T. Masselink, R. Fisher, H. Morkos. Appl. Phys. Lett., **46**, 51 (1985).
- [12] T. Mishima, I. Kasai, M. Morioka, Y. Sawada, Y. Katayama. Surf. Sci., **174**, 307 (1986).
- [13] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. *Квантовая механика* (М., 1989).
- [14] *Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры*, под ред. Л. Ченга, К. Плога (М., 1989).
- [15] J.M. Langen, H. Heinrich. Phys. Rev. Lett., **55**, 1414 (1985).
- [16] I. Bateri, S.L. Wright. J. Appl., **59**, 200 (1986).
- [17] H. Kroemer. Surf. Sci., **174**, 299 (1986).
- [18] M. Zahler. Appl. Phys. Lett., **61**, 949 (1992).
- [19] П.С. Копьев, И.Н. Уральцев, А.П. Эфрос, Д.Р. Яковлев, А.В. Винокурова. ФТП, **22**, 424 (1989).
- [20] C. Weisbuch, R. Dingle, A.C. Gossard, W. Wiegmann. Sol. St. Commun., **38**, 709 (1981).
- [21] Б.Я Бер, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Н.Н. Леденцов, Б.Я. Мельцер, И.Н. Уральцев, Д.Р. Яковлев. Изв. АН СССР, **49**, 1905 (1985).
- [22] T. Noda, M. Tanaka, H. Sakaki. Appl. Phys. Lett., **57**, 1651 (1990).
- [23] K. Hirakawa, T. Noda, H. Sakaki. Surf. Sci., **196**, 365 (1988).
- [24] S. Sakaki, T. Noda, K. Hirakawa, M. Tanaka, T. Natsusue. Appl. Phys. Lett., **51**, 1941 (1987).
- [25] В.И. Кадушкин, Е.Л. Шангина. ФТП, **27**, 1311 (1993).
- [26] В.А. Кульбачинский, В.И. Кадушкин, В.Г. Кытин, Е.Л. Шангина. ФТТ, **35**, 1755 (1993).
- [27] V.A. Kulbachinskii, A.de Visser, V.I. Kadushkin, V.G. Kytin, E.L. Shangina. J. Appl. Phys., **75**, 2081 (1994).
- [28] Ю. Каваляускас, Г. Кривайте, Л.В. Шаронова, А. Шилейка, Ю.В. Шмарцев. ФТП, **27**, 1086 (1993).
- [29] A.N. Ghatak, K. Thyagarajan, V.R. Shenoy. IEEE J. Quant. Electrum, **24**, 1524 (1988).
- [30] S. Sasa, K. Kondo, H. Ishikawa, T. Fujii, S. Muto, S. Hiyamiru. Surf. Sci., **174**, 433 (1986).

Редактор В.В. Чалдышев

## Photoluminescence of doped spaced superlattices GaAs/AlGaAs

V.I.Kadushkin, E.L.Shangina

Scientific Research & Technology Institute, 390011 Ryazan, Russia